

TECHNICAL SERVICES

技術サービスのご提供

We support a wide variety of polishing processes for trial production. And we can provide specific data (characteristics, shape, etc) on our processing surfaces according to your needs.

多種多様な基板研磨加工に対応致します。お客様のニーズに応じて、ご提供いただいた試作基板の加工表面及び形状等に関するデータ提供も致します。

(Works)
Various types of optical glass,
Advanced crystalline materials
(SiC, GaN, Sapphire...)
Ceramics, Metals, Resin,

(取扱基板例)
各種光学ガラス、SiC、GaN、
サファイア等の先進結晶材料、
セラミックス、金属、樹脂、
新規材料等

前加工～研磨加工において使用される機械装置のご相談もお受けいたします。試作基板の開発から内製化まで検討されているお客様はぜひお声がけ下さい。

We provide consultations on several machines from pre-processing to polishing. Please let us know if you have any considerations from development of trial materials to self-manufacturing.

R & D 向け 試作基板対応

Trial production for R&D

機械装置販売

Machinery sales

研磨技術

Polishing technology

各種資材の受託評価・研究、加工コンサルティング、関連装置販売をお受けします。
研磨加工に関するトータルソリューションをご提供致します。

We accept evaluations and commissioned research on processing sub-materials such as polishing slurry and polishing pads. We offer processing consulting and advice on related equipment sales. We provide total solutions for polishing technology

副資材 評価試験 受託研究

Evaluation test of
secondary material/
commissioned research

各種受託 評価分析

Various evaluation
and analysis

ユーザー視点での
開発支援により、資材の
競争力向上に寄与します。
By supporting development from
the user's perspective, we contribute
to improving the competitiveness
of your materials.

弊社の各種評価装置を活用した受託評価、分析もお受け致します。
We also accept outsourced
evaluation and analysis
using our various
evaluation devices.

評価装置



レーザー干渉計
Laser interferometer



表面検査装置
Optical surface analyzer



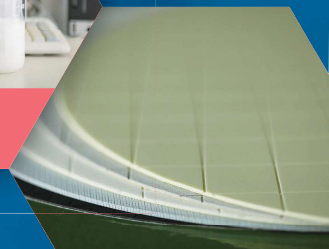
斜入射干渉計
Slanting incidence
interferometer



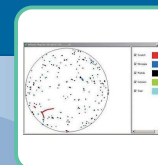
原子力間力顕微鏡
Atomic force microscope



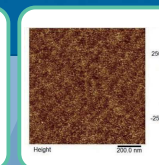
研磨スラリー
Polishing Slurry



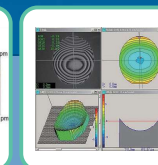
研磨パッド
Polishing pad



基板清浄度
Wafer cleanliness



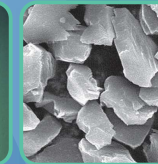
表面粗さ
Surface roughness



平坦性
Flatness



ダメージ・欠陥
Damage/Defect



砥粒評価
Abrasive evaluation

評価項目